電界紡糸ポリスチレンマイクロファイバ膜を用いたマスク型マイクロフォン

Mask-type microphone comprising electrospun polystyrene microfiber mat

京工繊大 〇高垣賢一,高橋京華,林知希,武内俊次、桑原教彰,石井佑弥

Kyoto Inst. °Kenichi Takagaki, Kyoka Takahashi, Tomoki Hayashi, Shunji Takeuchi,

Noriaki Kuwahara, Yuya Ishii*

E-mail: d2851502@edu.kit.ac.jp

はじめに: フィルムでは圧電効果を示さないアタクチックポリスチレン(aPS)が、電界紡糸のワンステップによるマイクロファイバ膜化のみにより、圧電材料の圧電特性に酷似した疑似圧電特性を示すことが報告されている[1,2]。この疑似圧電特性は、電界紡糸で形成される当該ファイバ膜が生来強誘電エレクトレットであることに由来する[2]。当該ファイバ膜はポーリングなどの後処理を必要としないため、省工程や省エネルギーで圧力センサやアクチュエータを製造できる可能性がある。本研究では、当該ファイバ膜の極軽量(0.036 g/cm³[3])かつ柔軟、通気性に優れるといったユニークな特徴をさらに生かしたマスク型マイクロフォンを開発し、動作特性を評価したので報告する。

実験: 基材となるマスクは、市販されている 一般的な使い捨て型の 3 層構造のマスクを分 解して使用した。開発したマスク型マイクロフ ォンの概説図を Fig. 1 に示す。4 層構造からな り、最外のポリプロピレン(PP)不織布層と最外 から3層目のPPフィルタ層は中心から円形状 に導電加工を施している。この導電加工部に aPS ファイバ膜を直接電界紡糸して用いた。最 外層のファイバ膜は-9.0kV で、3層のファイバ 膜は+9.0 kV でそれぞれ逆極性の電圧で電界紡 糸した。2層は1層と3層の導電加工部間のシ ョートを防止するため、4層は3層の導電加工 部と人体との接触を防止するために導入した。 結果: 電圧±9.0 kV で電界紡糸した aPS ファ イバ膜の走査電子顕微鏡(SEM)像を Fig. 2 に示 す。ビーズ状の不均一構造の見られない均一な ファイバが作製できていることが分かる。平均 直径はそれぞれ、4.18 μm(-9.0 kV 紡糸)と 3.55 μm(+9.0 kV 紡糸)であった。作製したマスク型 マイクロフォンに、日本人の声の代表的な周波 数である 120 Hz と 240 Hz のブザー音を与えて 出力電圧を測定したところ、ほぼ音圧に比例し た電圧が出力された。これは、音波により強誘 電エレクトレットである aPS ファイバ膜とこ の電極基板である PP 不織布の導電加工部もし くは PP フィルタの導電加工部が振動すること

で、導電加工部とファイバ膜間の距離が変化し、この結果導電加工部に誘導された誘導電荷量が変化したためであると考えられる。このマスク型マイクロフォンをタブレットのプラグに接続して、ヒトの声の文字変換を検討した。この結果、例えば「京都工芸繊維大学」という発声をタブレット上で文字変換できることを確認した。以上の結果より、開発したマスク型マイクロフォンが動作可能であることを示した。

謝辞: 本研究の一部は JSPS 科研費 22H01811 の助成を受けて実施された。

参考文献 [1] Y. Ishii et al. *Smart Mater. Struct.* **28**, 08LT02 (2019). [2] Y. Ishii et al. *Macromol. Rapid Commun.* **41**, 2000218 (2020). [3] Y. Ishii et al. *Mater. Chem. Phys.* **278** 125666 (2022).

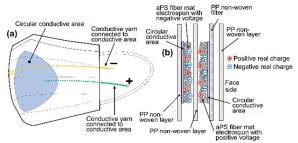


Fig. 1 Schematic diagram of the developed masktype microphone: (a) overview and (b) crosssectional view.

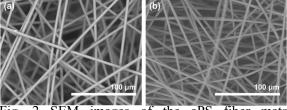


Fig. 2 SEM images of the aPS fiber mats electrospun with (a) -9.0 kV and (b) +9.0 kV.

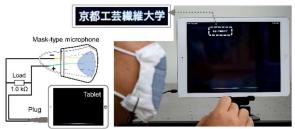


Fig. 3 Characterization of voice using the developed microphone and tablet.